实验D6 alpha能损

签名:

【实验目的】

- 1. 了解核辐射安全以及防护
- 2. 了解金硅面α谱仪的工作原理及其特性;
- 3. 通过测量分析两种α放射源241Am和239Pu的能谱形状(如:作能量刻度、求能峰和能量分辨率),掌握基本的α射线能谱的测量方法和能量刻度定标方法;
- 4. 通过利用α粒子测量箔膜的厚度; 了解天然射性α粒子与物质的相互作用过程;
- 5. 通过观察和数据处理,理解随机性在微观世界的普遍存在,以及统计方法的实验意义。

【仪器用具】

【实验原理】

α 衰变

原子核衰变时放出氦核,衰变形成的原子核有不同的能级,衰变至激发态原子核后,再放出不同频率的 γ 光子。

衰金硅面垒半导体探测器的基本原理

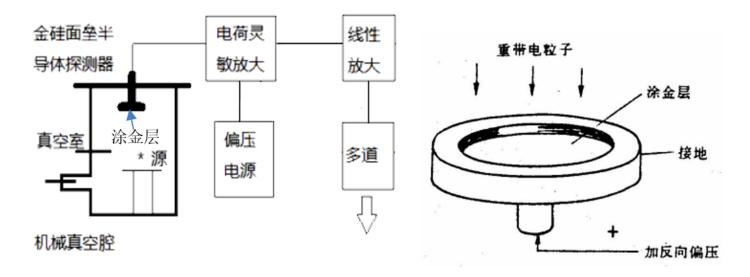


图 D6-2 金硅面垒半导体探测器结构图及金硅面垒的反向偏压

金硅面垒探测器作为PN结型半导体探测器的一种,是用一片N型硅,蒸上一层薄金层(100-200 埃),接近金膜的那一层硅具有P型硅的特性,这种方式形成的PN结靠近表面层,结区即为探测粒子的灵敏区。金硅面垒探测器工作时加反向偏压,粒子在灵敏区内损失能量转变为与其能量成正比的电脉冲信号,经放大并由多道分析器测量脉冲信号按幅度的分别,从而给出带电粒子的能谱。偏置放大器的作用是当多道分析器的道数不够用时,利用它切割,展宽脉冲宽度,以利于脉冲幅度的精确分析。为了提高谱仪的能量分辨率,探测器最好放在真空室中。另外金硅面垒探测器一般具有光敏的特性,在使用过程中,应有光屏蔽措施。

α谱仪的能量刻度和能量分辨率

用已知能量的α粒子源,测出该能量在多道分析器上所对应的谱峰位道址,作能量对应道址的刻度曲线,获得能量刻度

 α 谱仪的能量分辨率用能谱的半高宽度FWHM表示,表征了能谱仪分开不同能量粒子的本领。FWHM是谱线最大计数一半处的宽度,以道数表示,还可由谱仪的能量刻度常数转换为能量 Δ E,以keV表示。在实用中,谱仪的能量分辨率还用能量展宽的相对百分比表示,即 $\eta=\Delta E/E$

α 粒子的能量损失

α粒子与原子核之间发生卢瑟福散射的几率很小,它与物质的相互作用主要是与核外电子的相互作用。α 粒子与电子碰撞,将使原子电离、激发而损失其能量。在一次碰撞中,由于其质量较大,α粒子只有一小部分能量转移给电子,当它通过吸收体后,经过多次碰撞才会损失较多能量。每次碰撞基本不发生偏转,因而它通过物质的射程几乎接近直线。

带点粒子在吸收体内单位长度的能量损失率, 称为线性阻止本领S:

$$S = -rac{dE}{dx}$$

把S除以吸收体单位体积内的原子数N,称为阻止截面,它与粒子的能量E有关,用Σ(E)表示

$$\Sigma(E) = -\frac{1}{N} \frac{dE}{dx}$$

对非相对论性α粒子(v<<c),线性阻止本领用下面式子表示:

$$S = rac{4\pi z^2 e^4 NZ}{m_0 v^2} ln rac{2m_0 v^2}{I}$$

上式中的z为入射粒子的电荷数, Z吸收体的原子序数, e为电子的电荷, v为入射粒子的速度, N为单位体积内的原子数。I是吸收体中的原子的平均激发能。由于对数项随能量的变化是缓慢的, 因此可近似表示为:

$$S \propto \frac{const}{E}$$

当α粒子穿过厚度为ΔX的薄吸收体后,能量由E1变为E2,可写成

$$\Delta E = E_1 - E_2 = S_{rac{E_1 + E_2}{2}} \Delta x$$

则薄膜厚度为

$$\Delta x = rac{\Delta E}{S_{rac{E_1+E_2}{2}}} pprox rac{\Delta E}{S_{E_1}}$$

当α粒子能量损失比较小时,可以用上式来计算厚度,当薄膜比较厚时,α粒子能量在通过薄膜后损失很大,就应该用下式计算

$$\Delta x = \int_{E_2}^{E_1} rac{dE}{(-dE/dx)_E} pprox \Sigma_{E_1}^{E_2} rac{\delta E}{S_{E_1}}$$

一般来说α粒子能量在1keV-10MeV之间时,在铝膜中的阻止截面可由以下经验公式确定:

$$\Sigma(E) = \frac{A_1 E^{A_2} \left\{ \frac{A_3}{E/1000} \ln \left[1 + \frac{A_4}{E/1000} + \frac{A_5 E}{1000} \right] \right\}}{A_1 E^{A_2} + \frac{A_3}{E/1000} \ln \left[1 + \frac{A_4}{E/1000} + \frac{A_5 E}{1000} \right]}$$

式中A1,A2,A3,A4,A5为常数,见下表D6-2,α粒子能量E以keV为单位,得到的\Sigma_e以eV/1015atom·cm2为单位。对于化合物,它的阻止本领可由布拉格相加规则,将化合物的各组成成分的阻止本领(dE/dx)i相加得到,即

$$(rac{dE}{dx})_c = rac{1}{A_c} \Sigma Y_i A_i (rac{dE}{dx})_i (KeV/\mu g \cdot cm^{-2})$$

其中 Y_i 、 A_i 分别为化合物分子中的第i种原子数目、原子量, A_c (等于 $\sum_i Y_i A_i$) 是化合物的分子量。 利用已知的阻止截面,通过 α 粒子在铝膜中能量损失的测量,可以快速无损的测定薄膜的厚度, α 粒子的能量可用多道分析器测量,峰位可按最简单的重心法得到。

【实验步骤】

1. 观察探测的随机性和多道的使用练习。

探测器高压调至调整100V,放射源使用241Am,

- (1) 多道先不设置,记录能谱测量时间为3s,30s,300s时的能谱图,
- (2) 用归一化能谱将3个能谱有区分地绘制在同一张图中。
- (3) 按照说明书第五章,求解能谱的能量分辨率。
- (4) 练习使用多道分析仪。打开多道分析仪V2.7,设置多道分析器的,"设置"->"道数"变更为 "8192",采集峰位计数为100时的能谱图,比较不同道数 (1024道和8192道)测量能谱,分析能谱 参数差异(能量分辨率、峰位计数率、半高全宽等)。
- 2. 寻找探测器的最佳工作电压。

将多道分析器的道数调回1024,测量不同偏压下 (20V至130V) 的α粒子(241Am放射源)的能谱 (要求峰位计数为400左右),绘制不同偏压下的能量分辨率曲线和峰位曲线,进而确定探测器的工作偏压(判断标准:能量分辨率最好,峰位尽量高的探测器工作条件)。

3. 对探测器进行能量刻度

将探测器调至选好的最佳工作电压,测量241Am放射源 (5.486MeV) 以及239Pu (5.155MeV) 的能谱,对能量刻度定标 (要求峰位计数为400左右)。

4. 利用α粒子能损测量箔和膜的厚度(要求峰位计数为400左右)。 测量241Am的α粒子通过铝箔及Mylar薄膜后的能谱,并计算出其阻止本领和薄膜厚度。已知碳、氢、氧的原子密度分别为: $N(C)=1.136\times 1023 atm\cdot cm^{-3}, N(H)=5.376\times$

 $1023atm\cdot cm^{-3}, N(O)=5.367\times 1023atm\cdot cm^{-3}$ 。 质量密度为 $\rho_c=2.267g\cdot cm^{-3}$, $\rho_H=8.998\times 10^{-5}g\cdot cm^{-3}$, $\rho_O=0.001428g\cdot cm^{-3}$ 。

【预习思考题】

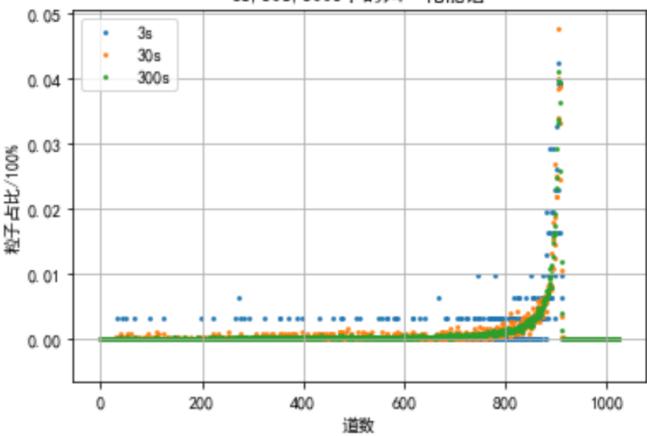
- 1. ^{64}Cu 可以发生 α 粒子衰变吗?为什么呢? ^{64}Cu 不能发生 α 粒子衰变,因为 $^{60}_{27}Co$ 的质量加上氦核的质量大于 ^{64}Cu 的质量。
- 2. (选) 预测同一个放射源测得的能谱峰位值的随偏压的变化趋势, 为什么?
- 3. 简述探测器能谱标定的方法以及能量分辨率的计算方法。 用已知能量的α粒子,测出该能量在多道分析器上所对应的谱峰位道址进行标定。 α谱仪的能量分辨率用能谱的半高宽度FWHM表示,表征了能谱仪分开不同能量粒子的本领。 FWHM是谱线最大计数一半处的宽度,
- 4. 预估使用239Pu,241Am两种放射源能测量的铝箔和mylar膜的厚度大约在什么量级(请用 g/cm^2 表示箔(膜)的厚度);为何在计算化合物的截止本领时,只需考虑化合物所含的元素及比例,而无需考虑元素的结合方式(化学键)? 厚度大约在 $10^{-6}\,g/cm^2$ 量级
 - 因为α粒子与电子发生作用主要是与电子发生碰撞使得原子电离,与化学键无关。
- 5. (选)实验过程中,若金硅面垒探测器的样品腔不抽真空,会对能量谱产生怎样的影响? α粒子电离能力强,会与空气分子碰撞,导致能量谱不会出现计数。
- 6. 实验前确定探测器最佳工作条件的原理是什么? 改变偏压使得能量分辨率最好,峰位尽量高。

【实验数据处理】

1.观察探测的随机性和多道的使用练习

3s, 30s, 300s测量时间下测量能谱图, 归一化后如图所示

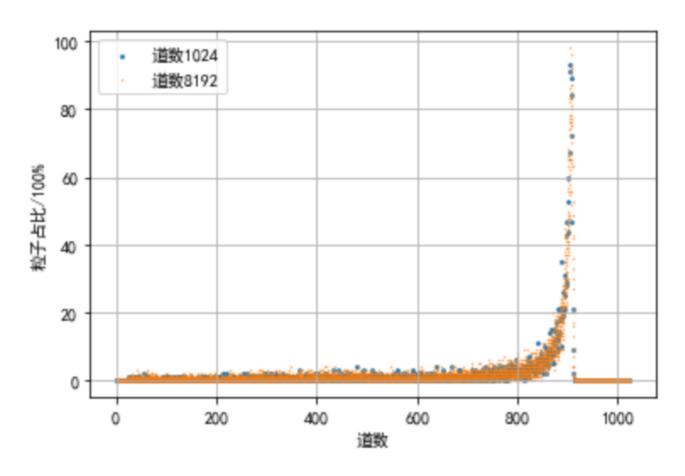
3s, 30s, 300s下的归一化能谱



寻峰后,可得各时间下能谱的分辨率为

能谱测量时间	能谱分辨率
3s	1.19%
30s	1.18%
300s	1.18%

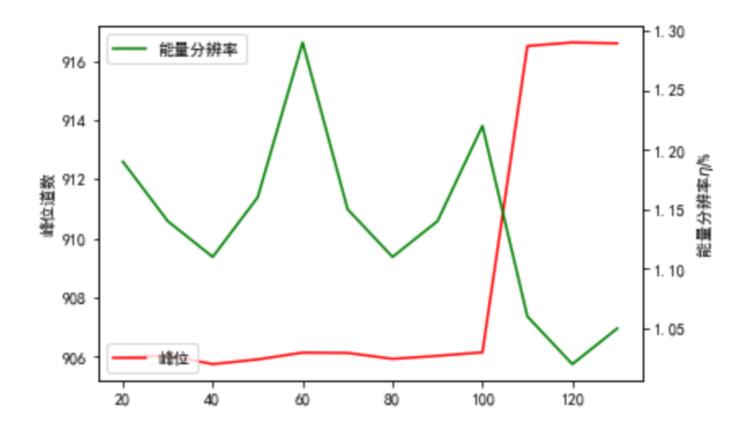
1024道和8192道下的能谱如图



	能量分辨率	半高全宽	峰位计数率
1024道	1.40%	13.75	4.07%
8192道	1.57%	123.36	1.10%

2.寻找最佳工作电压

将偏置电压从30V加到130V,记下各电压下的峰位道数和能量分辨率如图所示

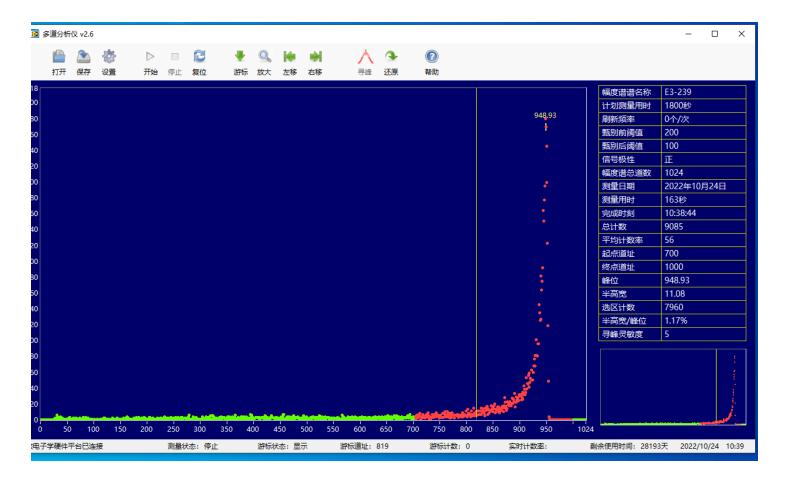


可见偏置电压为120V时峰位最高,能量分辨率最好。

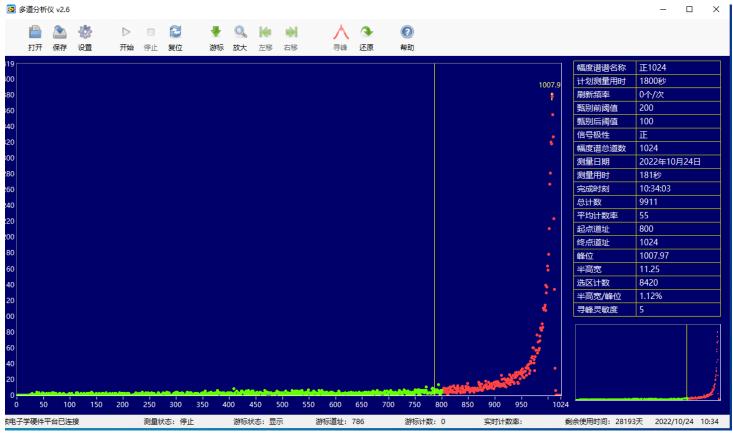
3.对探测器进行能量刻度

更换不同放射源测得, ^{241}Am (5.486MeV)的峰位道数为1007.97, ^{239}Pu (2.1155)的峰位道数为948.93。可得

$$G = rac{5.486 - 5.1155}{1007.97 - 948.93} = 6.275 \cdot 10^{-3} MeV$$
 $E_0 = 5.486 - 6.275 \cdot 10^{-3} \cdot 1007.97 = -0.839 MeV$
 $E = G \cdot d + E_0 = 6.275 \cdot 10^{-3} d + -0.839 MeV$







4.利用α粒子能损测量箔和膜的厚度

	峰位	ΔE	阻止本领	薄膜厚度
AI膜	611.86	1.647MeV	1540.8MeV/cm	10.69 μm
Mylar膜	754.61	0.751MeV	8131MeV/cm	0.924 μm